

# ケーブリング

センターエリアでPEMを設置し、測定するためにケーブリングを行った。

SR3ラックにBNC-Dsub convertorを用意したので、それに向けてIX0ラックからDsubケーブルを這わせた。50m+20m

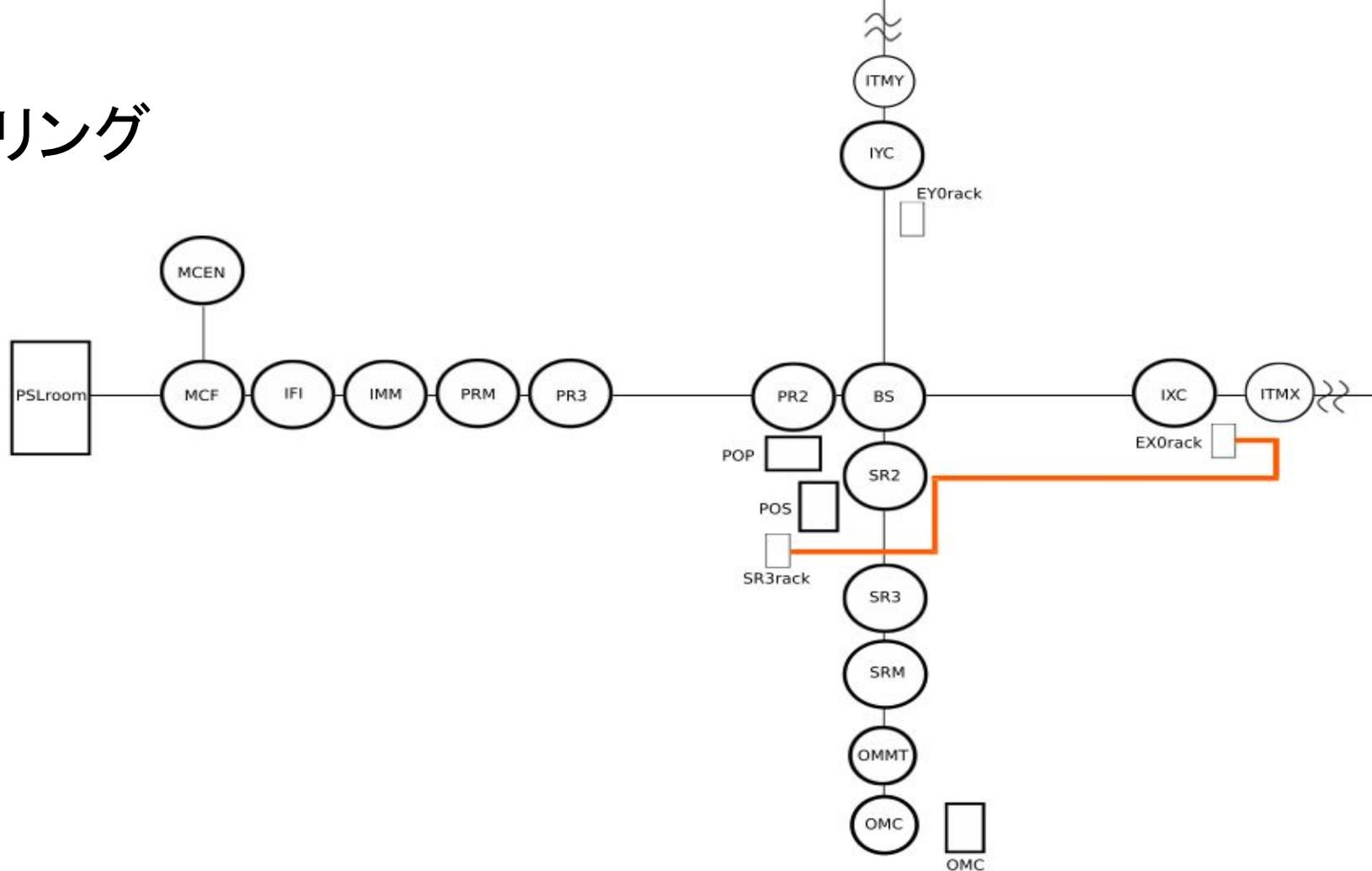
IX0(Anti Aliasing chassis)[IN17~20]-->SR3(convertor)[Ch1~4]

IX0(Anti Aliasing chassis)[IN21~24]-->SR3(convertor)[Ch5~8]

IX0(Anti Aliasing chassis)[IN25~28]-->SR3(convertor)[Ch9~12]

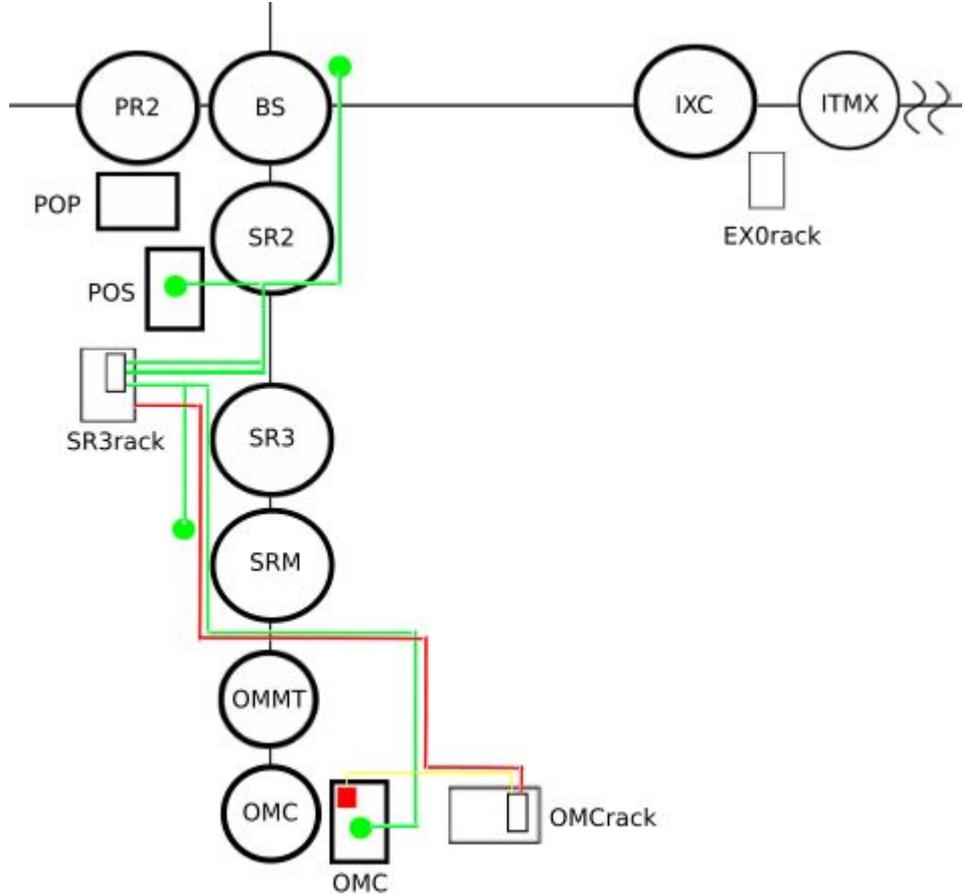
IX0(Anti Aliasing chassis)[IN29~32]-->SR3(convertor)[Ch13~16]

# ケーブリング

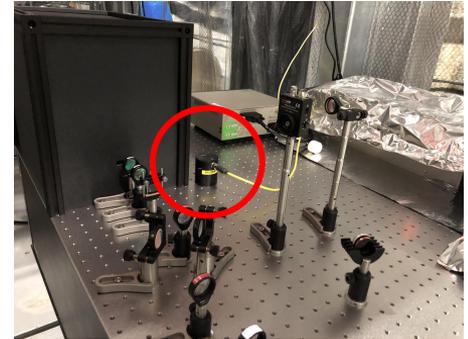
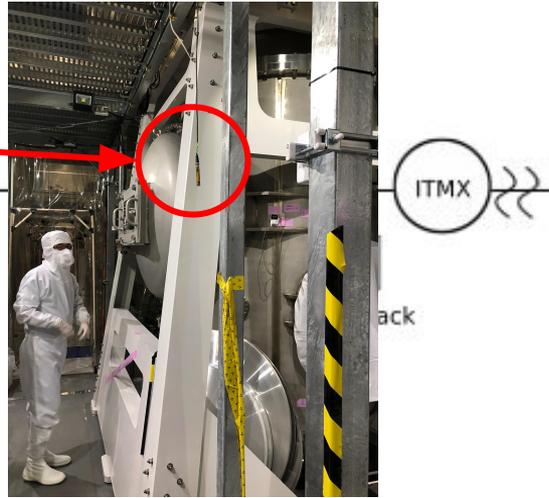
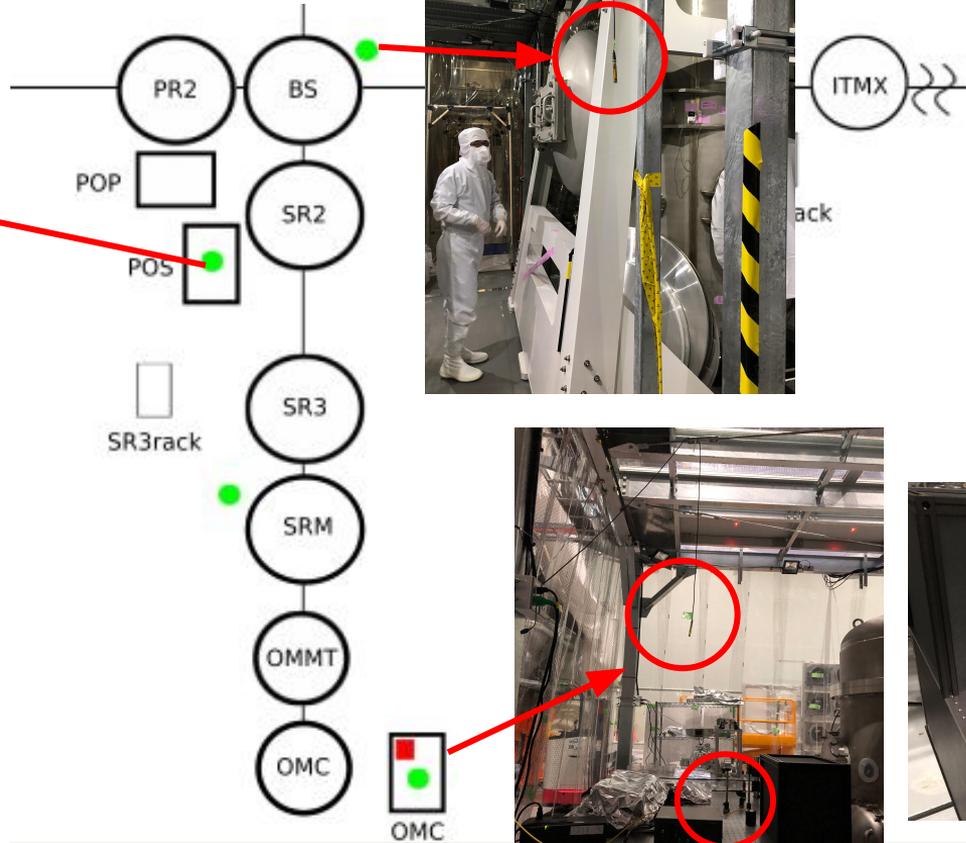
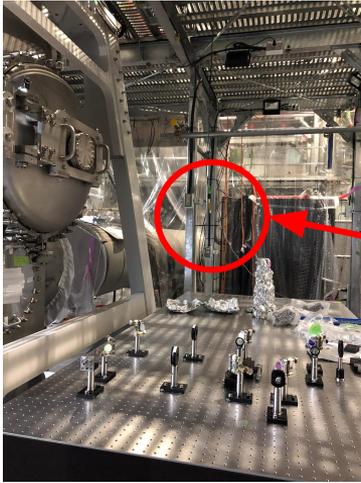


# センサー設置場所・ケーブルリング

SR3ラックから各センサーの設置場所まで、20m(+10m)のBNCケーブルを這わせた。



# センサー



# ケーブルリング

BNC-Dsub convertorのCh1から順に、

[Ch1]-----[Mic] OMC定盤

[Ch2]-----[Mic] POS定盤

[Ch3]-----[Mic] BSチェンバー(X-arm side)

[Ch4]-----[Mic] SRM(チェンバー付近)

[Ch5]-----[ACC]OMC定盤

[Ch6以降] empty

# Mic

OMC[1809035] 音場型 20Hz~20kHz

POS[1809036] 超低周波型 1Hz~20kHz

BSチェンバー(X-arm side)[1809034] 拡散型 20Hz~10kHz

SRMチェンバー[1809038] 音場型 20Hz~20kHz

# Accelerometer

OMC[1809327] TEAC社製 0.02Hz~200Hz

Amp[1809331] OMCラックの一番上段に設置した。



# 雑音マップ作成のための測定

音響、磁場雑音マップの作成

マイク[1809323]と磁束計[1707535]を使って測定した。

機械特有の雑音分かるように長い時間でフーリエ変換

→diaggi BW=0.05Hz, AV=20, Overlap=50%の設定



# 雑音マップ作成のための測定

磁束計はラックの前で測った。(IY0, IX0, OMC, IMC)

磁束計の軸の向き(x, y, z)は干渉計のarmの向きとそろえた。(z軸が天井向き)

マイクは大まかなエリアごとに測定した後、磁束計と同じ場所を同時に測った。

今週末、クリーンルーム内もデータをとる。



# 雑音マップ作成のための測定

測定した場所

赤丸がマイク

青バツが磁束計

